

И. А. ГЕРКО, В. И. ХРУПА, В. П. КЛАДЬКО,  
Е. Н. КИСЛОВСКИЙ, В. Н. МЕРИНОВ

---

**РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ  
СТРУКТУРНОЙ ОДНОРОДНОСТИ КРИСТАЛЛОВ CdTe**

**Институт полупроводников АН УССР, Киев**

Параметры приборов, изготавливаемых на основе кристаллов CdTe, зависят не только от среднего уровня искажений решетки, но и от степени структурной однородности

материала. В этой связи важной задачей является разработка методик контроля структурной однородности кристаллов CdTe.

Для сравнительно несовершенных кристаллов полупроводниковых соединений (при плотности дислокаций  $N_d > 5 \cdot 10^3 \text{ см}^{-2}$ ) количественная информация о степени их структурного совершенства может быть получена при анализе интегральных интенсивностей лауз-дифрактированных пучков  $I_R(h)$  рентгеновских лучей (РЛ) в условиях небольших уровней поглощения  $h < 3$  ( $h = \mu t / \cos \theta$ ;  $\mu$  — линейный коэффициент поглощения;  $t$  — толщина образца;  $\theta$  — угол Брэгга) [1, 2]. В этом случае по значению прироста интенсивности отражения в дефектном кристалле по сравнению с совершенным образцом  $\Delta I_R(h) = I_R(h) - I_R^c(h)$  легко оценить величину относительной объемной доли дефектов  $Q_0$  в облучаемом объеме по приближенной формуле

$$\Delta I_R(h) = [Q h Q_0 \exp(-h/\mu)] \cdot I_0,$$

где  $Q$  — кинематическая рассеивающая способность единицы объема;  $I_0$  — интенсивность первичного пучка. В настоящее время установлена более точная связь значений  $I_R(h)$  с характеристиками дефектов [3]. Однако при проведении сравнительного анализа степени структурного совершенства большого числа образцов одинаковой толщины удобно пользоваться указанным простым выражением. Для получения более детальной информации о степени и характере искажений решетки можно затем воспользоваться методиками [3], основанными на сравнительном анализе толщинных зависимостей  $I_R(h)$  и  $I_R^c(h)$ .

При дифрактометрических исследованиях структурной однородности материала осуществляют последовательное сканирование первичного пучка РЛ по входной поверхности кристалла вдоль заданных кристаллографических направлений [4], что позволяет получить радиальное распределение интегральных характеристик структурного совершенства ( $Q_0$ ,  $N_d$  и др.) образца. Методика [4], в которой используется монохроматизированное характеристическое MoKa-излучение, применима для контроля геометрически очень тонких ( $t < 100 \text{ мкм}$ ) кристаллов CdTe. Недавние исследования<sup>1</sup> показали, что регистрация  $I_R(h)$  методом однокристального спектрометра [5] при использовании как характеристических, так и непрерывных компонент спектра РЛ обеспечивает достаточную точность измерения интенсивностей отражений (6%). Это обстоятельство, как будет показано ниже,

позволяет существенно расширить диапазон пригодных для исследований толщин кристаллов CdTe.

Цель настоящей работы заключалась в расширении возможностей методики исследования структурной однородности кристаллов CdTe при лауз-дифракции РЛ выбранной длины волны в условиях небольших уровней поглощения и применении ее для контроля промышленных образцов.

Объектами исследований являлись моно-кристаллические пластины толщиной  $430 \pm 10 \text{ мкм}$ . Отклонение поверхности образцов от плоскости (111) не превышало  $15'$ .

Образцы № 1—6 (см. таблицу) были приготовлены из нелегированного материала, полученного методом направленной кристаллизации. Образец № 6 был вырезан из слитка, выращенного из раствора-расплава с избытком Te (20 ат. %). Образцы № 7—9 готовились из легированного Se, также полученного методом направленной кристаллизации (образцы № 7 — 2 % ат. Se, образцы № 8, 9 — 4 % ат. Se).

Степень структурного совершенства образцов предварительно контролировалась металлографическим методом избирательного травления (ИТ). Информация о значениях средней плотности дислокаций  $N_d$  и наличии имеющихся малоугловых границ  $N_{\text{муг}}$  приведена в таблице. Из металлографических данных следует, что для нелегированных образцов только в отдельных случаях удается получить монокристаллический материал, не содержащий блочных структур (образцы № 1, 5, 6). При этом минимальная плотность дислокаций наблюдается в образце № 6, содержащем избыток Te. Видно также, что «слабое» легирование Se образца № 7 приводит к увеличению степени искажений решетки. В то же время при дальнейшем увеличении концентрации Se происходит заметное улучшение структурных характеристик материала.

#### Сопоставление рентгеновских и металлографических данных о степени структурного совершенства кристаллов CdTe

Номер образца	Метод избирательного травления		Рентгеновские измерения			
	$N_d \cdot 10^{-5}, \text{ см}^{-2}$	$N_{\text{муг}}, \text{ см}^{-1}$	$I_R, \text{ имп/с}$	$\Delta I_R, \text{ имп/с}$	$Q_0 \cdot 10^2$	$\Delta Q_0 \times 10^3$
1	10	0	5340	4230	8,49	54,9
2	5	4,5	4530	3100	4,69	9,1
3	1,5	100	4030	2900	5,31	15,7
4	5	90	3800	2550	4,41	11,9
5	4	0	2030	900	1,79	2,35
6	1	0	220	1100	2,19	10
7	3	10	3820	2650	5,18	17,4
8	1,7	0	2180	880	1,48	1,97
9	0,9	0	1880	700	1,3	4,6

<sup>1</sup> Низкова А. И. Влияние структурного совершенства легированных монокристаллов на динамическое рассеяние рентгеновских лучей. Автореф. канд. дис. Киев, 1986.

Регистрация интегральных интенсивностей рефлексов типа 220 при дифракции излучения непрерывного спектра в длинноволновой области вблизи  $K$ -края поглощения атомов Cd ( $\lambda_K=0,475 \text{ \AA}$ ) осуществлялась методом однокристального спектрометра [5]. Анализ экспериментальных зависимостей  $\mu(\lambda)$  для кристаллов CdTe показал, что для  $\lambda_K$  (значение  $\mu$  составляет  $60 \pm 2 \text{ см}^{-1}$ ) удается добиться минимальных величин уровня поглощения излучения ( $h = 2,58$  для указанных  $t$ ) и поэтому с практической точки зрения переход к меньшим длинам волн, расположенным в коротковолновой области тормозного спектра РЛ, нецелесообразен.

Измерения интенсивности первичного пучка  $I_0$  для углового и спектрального интервала излучения, дифрагирующего в исследуемых кристаллах, проводились с помощью совершенных образцов сравнения [5], приготовленных из бездислокационных кристаллов Si и InSb. Для обоих материалов получены аналогичные результаты  $I_0 = 3,5 \times 10^8 \text{ имп/с\cdotрад}$ . Для данной величины  $I_0$  расчетное [3] абсолютное значение  $I_R^*(h)$  для совершенных кристаллов CdTe составляет 1190 имп/с.

В процессе измерений осуществлялось последовательное сканирование образцов с шагом 2 мм вдоль двух взаимно перпендикулярных направлений [110] и [112] относительно первичного пучка РЛ размером  $0,5 \times 0,5$  мм. На основании совокупности полученных для каждой координаты величин определялись средние по образцу зна-

чения  $\bar{I}_R(h)$  и  $\Delta\bar{I}_R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta I_{R,i}$ , где  $N$  — число точек, по которым затем рассчитывались (по указанной формуле  $Q = 4,72 \times 10^{-2} \text{ см}^{-1}$ ) средние значения параметров

$\bar{Q}_0$  и  $\Delta\bar{Q} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\bar{Q}_0 - Q_{0,i}|$ . Отметим, что если значение  $\bar{Q}_0$  описывает средний уровень искажений решетки, то величина  $\Delta\bar{Q}_0$  может характеризовать степень структурной однородности образца. Результаты измерений и расчетов приведены в таблице.

Анализ совокупности полученных металлографических и рентгеновских данных позволяет сделать вывод о том, что в целом наблюдается удовлетворительная корреляция значений  $\bar{N}_d$  с величинами  $Q_0$ . В то же время на фоне общих закономерностей изменения степени несовершенства материала при варировании технологических условий для отдельных образцов наблюдается резкое отличие этих структурных характеристик. Это наглядно видно для образца № 6, когда металлографическое значение  $\bar{N}_d$  не коррелирует с величиной  $Q_0$ . Очевидно,

это связано с тем обстоятельством, что метод ИТ выявляет не все имеющиеся дефекты, в то время как интегральная величина  $\Delta I_R$  (и соответственно  $Q_0$ ) учитывает все без исключения искажения решетки, независимо от их природы. Поэтому по значению  $Q_0$  можно более объективно оценить средний уровень искажений решетки.

Анализ значений  $\Delta Q_0$  показал, что введение данной характеристики существенно повышает информативность дифрактометрических исследований и позволяет более надежно по сравнению с методом ИТ характеризовать степень структурной однородности кристаллов. Имеющиеся данные позволяют как для нелегированного, так и для легированного материала легко выделить сравнительно структурно-неоднородные кристаллы (образцы № 1—4, 6, 7), характеризующиеся значительными (абсолютными и относительными) величинами  $\Delta Q_0$ , а также более однородные кристаллы (образцы № 5, 8, 9). Обращает на себя внимание резкая неоднородность образца № 1, в котором методом ИТ не выявлено малоугловых границ. «Слабое» легирование Se (образец № 7), как видно из таблицы, также приводит не только к увеличению среднего уровня искажений решетки, но и к значительной неоднородности материала. В то же время при дальнейшем увеличении уровня легирования кристаллов (образцы № 8, 9) наблюдается повышение как степени структурного совершенства, так и структурной однородности материала. Аналогичная картина наблюдалась при исследовании легированных монокристаллов группы  $A^3B^5$ , в частности GaAs [6], которая объясняется повышением критического уровня образования дислокаций с введением в кристалл легирующей примеси определенной концентрации. Таким образом, с помощью предложенной методики рентгеновских дифрактометрических исследований при лауз-дифракции РЛ в условиях невысоких уровней поглощения можно осуществлять достаточно экспрессный неразрушающий контроль степени структурного совершенства и однородности кристаллов CdTe. Информативность и надежность рентгеновских данных существенно выше, чем метода избирательного травления.

Погрешность определения предложенных параметров  $\bar{Q}_0$  и  $\Delta\bar{Q}_0$  составляет 10—15 % при точности измерения  $I_R(h)$  6 %. Время контроля одного образца диам. 2—4 см при юстировке в ручном режиме составляет 5—10 мин.

## ЛИТЕРАТУРА

- Даценко Л. И., Крыштаб Т. Г., Кладъко В. П. и др. / Украинский физический журнал. 1984. Т. 29. № 5. С. 743—747.

2. Молодкин В. Б., Даценко Л. И., Хрупа В. И. и др. / Металлофизика. 1983. Т. 5. № 6. С. 7—15.
3. Крыштаб Т. Г., Хрупа В. И., Даценко Л. И. / Украинский физический журнал. 1986. Т. 31. № 12. С. 1845—1849.
4. Даценко Л. И., Крыштаб Т. Г., Кисловский Е. Н., Хрупа В. И. / Заводская лаборатория. 1984. Т. 50. № 5. С. 38—39.
5. А. с. 1255906 СССР. Способ контроля структурного совершенства монокристаллов / Даценко Л. И., Гуреев А. Н., Хрупа В. И. и др. // Открытия. Изобретения. 1986. № 33.
6. Мильвидский М. Т., Освенский В. Б. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников.— М.: Металлургия, 1984.— 255 с.

Поступила 12.03.1987 г.